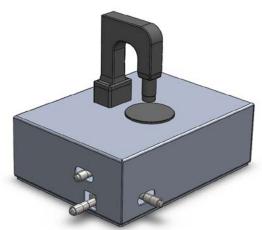
## 微区薄膜测量仪及反射光度计



微区薄膜测量仪及反射光度计:用于微米级表面尺寸光学反射率、薄膜厚度及膜 层材料光学参数(n&k)的快速测量。可以在 0.1 秒钟内同时获取单层薄膜的厚度 和材料光学参数。该仪器可用于各种环境,如实验室、工厂生产线及野外的实时 测量。

## 关键优势:

- **小光斑**: 测量光斑直径从 5 μm到 100 μm;
- **测速快**: 单点测量时间小于 0.1 秒:
- **精度高**: 反射率精度 0.3 %, 膜厚精度达 0.2 nm;
- 波长范围: 350 nm 至 1000 nm , 1000 nm 至 1700 nm:
- 小型便携: 重量 2.8 公斤, USB 连接计算机, 软件易学好用。

## 应用领域:

- ✓ 光学镀膜: 镜片增透膜、高反膜、分光膜测量;
- ✓ 医疗器件:内窥镜镜片反射率、内聚对二甲苯保护层、医疗器械表面涂层测量;
- ✓ 半导体制造: 二氧化硅 ( $SiO_2$ )、 氮化硅 ( $Si_3N_4$ )、 ITO (氧化铟锡)、有机发光 层、聚酰亚胺(PI)、光刻胶厚度测量:
- ✓ 太阳能电池: 氮化硅减反射膜、氧化铝钝化层测量。

参数	技术指标
测量内容	反射率,膜层厚度及光学常数(n&k)
光斑尺寸	5 μm, 10 μm, 50 μm, 80 μm, 100 μm
膜厚范围	15 nm 至 100 μm,精度为 0.2 nm
测量时间	单点测量时间小于 0.1 秒
光谱范围	350 nm 至 1000 nm , 1000 nm 至 1700 nm
样品尺寸	1 mm 至 100 mm
仪器重量	2.8公斤
仪器尺寸	29 x 23 x 25 cm
数据处理	USB 数据传输,配套软件 Film_Analyzer
操作系统	Windows 10及以上系统
电源	100-240 VAC,50/60 Hz,0.4 A



电话: 0755-84870203 邮箱: sales@highlightoptics.com